

AEC/APC Symposium Asia 2023プログラム

※プログラムは変更の可能性がございます

		Chair	Paper #	Title	Speaker	Affiliation
<b>一橋記念講堂</b>						
9:15	9:45				受付開始	
<b>Opening &amp; Tutorial 1 Speech</b>						
9:45	9:50	平井 都志也 KOKUSAI ELECTRIC		Opening Remarks from AEC/APC Asia	西村 英孝	ルネサスエレクトロニクス
9:50	9:55			プログラムアウトライン	柿沼 英則	キオクシア
9:55	10:40		<b>Tutorial-1</b>	<ONLINE> 人工知能・機械学習による実践的な分子・材料・プロセスの設計およびプロセス管理	金子 弘昌	明治大学
<b>Session 1</b>						
10:40	11:00	田中 尚人 東京エレクトロン	黒澤 敬 アズビル	<b>GX-018</b>	Smart Subfab Transformation using Context-Based Control	Holland Smith インフィコン
11:00	11:20			<b>PTL-013</b>	Unified Platform for detecting faults governed by Process Controls	Vishali Ragam アプライド マテリアルズ
11:20	11:40			<b>DA-016</b>	Mixed-type Defect Pattern Classifications	Takumi Maeda 筑波大学
11:40	12:00			<b>YM-009</b>	画像生成モデルを用いた未知パターンの不良ウェアマップ分類に関する一検討	Seima Sakaguchi 三重大学
12:00	13:00				展示・昼食	
<b>Keynote Speech</b>						
13:00	13:45	柿沼 英則 キオクシア	<b>Keynote</b>	コンピューティングの未来 - ビット/ニューロン/キュービット -	山道 新太郎	日本アイ・ビー・エム 東京基礎研究所
<b>Session2</b>						
13:45	14:05	樋谷 孝裕 ユナイテッド・セミコンダクター・ ジャパン	田中 知哉 タワー パートナーズ セミコンダク ター	<b>PTL-007</b>	Machine Learning Based Virtual Metrology for Effective Process Control in High Product Mix Manufacturing	Hyung Joo Lee Siemens EDA
14:05	14:25			<b>PTL-019</b>	低開口率エッチングの終点検出のためのRFモニタリング方法	Chuhua Song インフィコン
14:25	14:45			<b>PTL-008</b>	Comparison of Numerical Method with Prefixed Profile and Machine Learning-based Method for Wet Etching Amount Prediction	Chihiro Matsui 東京大学
14:45	15:05			<b>DA-012</b>	パワートランジスタの特性ばらつき之母集団推定と回路シミュレーションへの応用	Haruka Fukumoto ローム
15:05	15:25			<b>DA-017</b>	後工程における機械学習を用いた不良率予測	Yumiko Miyaji ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
15:25	15:45				展示・コーヒーブレイク	
<b>Tutorial 2 Speech</b>						
15:45	16:30	三宅 賢治 オフィス三宅	<b>Tutorial-2</b>	チップレット集積技術	栗田 洋一郎	東京工業大学
<b>Session3</b>						
16:30	16:50	土山 洋史 インフィコン	濫木 俊一 ソニーセミコンダクタマニュファク チャリング	<b>DA-011</b>	故障予知機能を搭載したインテリジェントモータリブ	Hiroyuki Kawazato 伸和コントロールズ
16:50	17:10			<b>MEP-010</b>	Development of Versatile Fault Detection Using Image Sensors	Takuya Sugiura ルネサスエレクトロニクス
17:10	17:30			<b>DA-014</b>	Anomaly detection of semiconductor manufacturing equipment by cluster analysis	Yuki Shiga KOKUSAI ELECTRIC
17:30	17:50			<b>PTL-015</b>	Root Cause Analysis of Plasma Processes Perturbation using Optical Emission Spectroscopy Signals with Modified Autoencoder	Jaehyeon Kim Sungkyunkwan Univ.
17:50	18:00					
<b>中会議室</b>						
18:00	18:30	坂本 浩一 東京エレクトロン			オーサーズインタビュー	
18:30	19:20				展示・レセプション	
19:20	19:30				Best Paper & Student Award	